

# フレキシブル有機EL用RTR成膜装置

## RTR equipment for Flexible OLED

Hitz日立造船独自の技術により、次世代照明として期待されるフレキシブル有機EL照明の製造方式を開発し、ベーキング・プラズマ洗浄 - 有機蒸着 - 金属蒸着 - パターニング - 封止処理を一貫連続処理できるRTR装置を提供します。

フレキシブル基材としてプラスチックフィルムに加え、ガラスフィルムにも対応できます。

The Production method of flexible organic EL lighting expected as next generation lighting was developed by Hitz Hitachi Zosen's proprietary technology. We propose RTR equipment which can process of baking/plasma cleaning - organic layer deposition - metal layer deposition - patterning - sealing treatment consistently. The proposed equipment can handle not only plastic films but also glass film.

### 特徴 Features

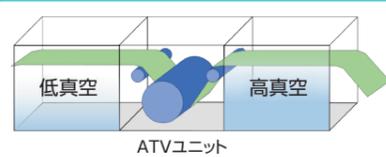
- 有機層成膜にはバルブ付蒸発源、金属層成膜にはダメージレス電子ビーム(EB)蒸着源を搭載することで、長時間連続運転、高生産性、低フットプリント、高膜厚均一性および高材料利用効率を実現  
This RTR equipment mounted with linear sources converted from planar source and damage less EB evaporation source can implement long-term continuous operation, high productivity, low footprint, high film thickness uniformity and high material utilization efficiency.
- 蒸着とパターニングを連続処理にて同時に実現  
This RTR equipment can implement depositing and patterning simultaneously.
- 前処理から、有機層成膜、金属層成膜に加え、封止、ラミネートまで連続一貫処理にて実現  
This RTR equipment can implement to process of pretreatment - organic layer deposition - metal layer deposition - sealing - laminate processing consistently.

### その他用途事例 Other application.

有機半導体/フィルムデバイス/機能性フィルム  
Organic semiconductor / Film device / Functional film  
有機太陽電池/  
ウエットコーティング + ドライコーティング  
Organic solar cell /  
Wet coating + Dry coating

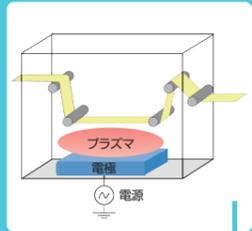
#### ATV装置 Air to Vacuum

異なる真空度や環境をインライン化できるユニット  
Connecting unit between different pressure or environment.



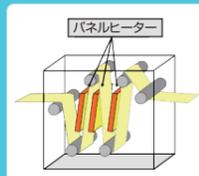
#### プラズマ洗浄装置 Plasma Cleaning

フィルム表面の有機物の除去/  
表面改質  
Removal of organic  
contaminant surface and  
modification on the film.



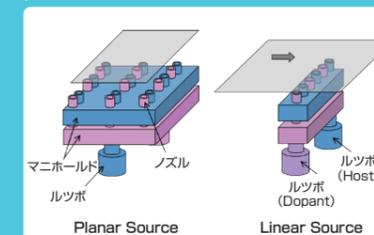
#### ベーキング装置 Film baking

フィルムの水分除去  
Removal of moisture  
and solvent of the  
film.

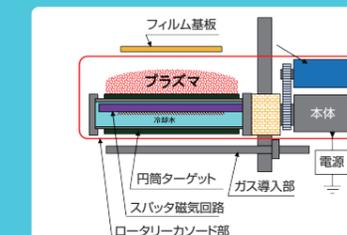


### 成膜室(Hitz 成膜源) Deposition chamber

面蒸着源転用リニアソース  
Linear source converted from  
planar source



Hitzロータリーカソード  
Rotary cathode



ダメージレスEB蒸着  
Damage less EB evaporation  
source

